日本 国 特 許 庁 JAPAN PATENT OFFICE



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2000年12月25日

出 願 番 号

Application Number:

特願2000-392828

出 **願**Applicant(s):

セイコーエプソン株式会社

2001年11月30日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Japan Patent Office





特2000-392828

【書類名】

特許願

【整理番号】

J0081047

【提出日】

平成12年12月25日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G02F 1/1343

【発明者】

【住所又は居所】

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株

式会社内

【氏名】

露木 正

【発明者】

【住所又は居所】

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株

式会社内

【氏名】

松尾 睦

【発明者】

【住所又は居所】

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株

式会社内

【氏名】

田中 千浩

【特許出願人】

【識別番号】

000002369

【氏名又は名称】

セイコーエプソン株式会社

【代理人】

【識別番号】

100093388

【弁理士】

【氏名又は名称】

鈴木 喜三郎

【連絡先】

0266-52-3139

【選任した代理人】

【識別番号】

100095728

【弁理士】

【氏名又は名称】 上柳 雅誉

【選任した代理人】

【識別番号】 100107261

【弁理士】

【氏名又は名称】 須澤 修

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013044

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9711684

【プルーフの要否】 要 【書類名】

明細書

【発明の名称】

液晶装置用基板、液晶装置用基板の製造方法、液晶装置

及び液晶装置の製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 液晶を挟持する一対の基板のうち観察側と反対側に位置する 液晶装置用基板において、

基材と、該基材の表面に形成された光反射膜とを有し、

該光反射膜の表面には複数の山部を並べて成るパターンが形成され、

該山部は、自らを通る直交2軸線の一方の軸線に沿った立体形状と、他方の軸線に沿った立体形状とが互いに異なることを特徴とする液晶装置用基板。

【請求項2】 液晶を挟持する一対の基板のうち観察側と反対側に位置する 液晶装置用基板において、

基材と、該基材の表面に形成された光反射膜とを有し、

該光反射膜の表面には複数の山部を並べて成るパターンが形成され、

該山部は、自らを通る直交2軸線のうちの少なくとも一方の軸線によって区分 される一方の側の立体形状と他方の側の立体形状とが互いに非対称であることを 特徴とする液晶装置用基板。

【請求項3】 請求項2において、前記立体形状の面積が前記一方の側と前 記他方の側とで非対称であることを特徴とする液晶装置用基板。

【請求項4】 請求項2又は請求項3において、前記立体形状の前記基材に対する角度が前記一方の側と前記他方の側とで非対称であることを特徴とする液晶装置用基板。

【請求項5】 請求項2から請求項4の少なくともいずれか1つにおいて、前記山部は、平面断面が長方形のピラミッド形状、平面断面が長方形のドーム形状、平面断面が楕円のドーム形状又は平面断面が長円のドーム形状であることを特徴とする液晶装置用基板。

【請求項6】 請求項1から請求項5の少なくともいずれか1つにおいて、 前記直交2軸線の少なくとも一方は前記基材の端辺に平行であることを特徴とす る液晶装置用基板。 【請求項7】 液晶を挟持する一対の基板のうち観察側と反対側に位置する 液晶装置用基板において、

基材と、該基材の表面に形成された光反射膜とを有し、

該光反射膜の表面には複数の山部を並べて成る光反射パターンが形成され、

該光反射パターンで反射する光の光量に関して、前記山部を通る直交 2 軸線の 一方に沿った光量プロファイルと、直交 2 軸線の他方に沿った光量プロファイル とが互いに異なることを特徴とする液晶装置用基板。

【請求項8】 請求項7において、前記一方の軸線に沿った光量プロファイルは山形状であり、前記他方の軸線に沿った光量プロファイルは直線状であることを特徴とする液晶装置用基板。

【請求項9】 液晶を挟持する一対の基板のうち観察側と反対側に位置する 液晶装置用基板の製造方法において、

基材の表面に光反射膜を形成する工程と、

マスクを用いて前記光反射膜の表面に複数の山部を形成する工程とを有し、

前記複数の山部に対応する前記マスクのマスクパターンは、自らを通る直交 2 軸線の一方の軸線に沿った形状と、他方の軸線に沿った形状とが互いに異なることを特徴とする液晶装置用基板の製造方法。

【請求項10】 液晶を挟持する一対の基板のうち観察側と反対側に位置する液晶装置用基板の製造方法において、

基材の表面に光反射膜を形成する工程と、

マスクを用いて前記光反射膜の表面に複数の山部を形成する工程とを有し、

前記複数の山部に対応する前記マスクのマスクパターンは、自らを通る直交 2 軸線のうちの少なくとも一方の軸線によって区分される一方の側の形状と他方の側の形状とが互いに非対称であることを特徴とする液晶装置用基板の製造方法。

【請求項11】 液晶を挟持する一対の基板と、観察側と反対側の前記基板の表面に形成された光反射膜とを有する液晶装置において、

該光反射膜の表面には複数の山部を並べて成るパターンが形成され、

該山部は、自らを通る直交2軸線の一方の軸線に沿った立体形状と、他方の軸線に沿った立体形状とが互いに異なることを特徴とする液晶装置。

【請求項12】 液晶を挟持する一対の基板と、観察側と反対側の前記基板の表面に形成された光反射膜とを有する液晶装置において、

該光反射膜の表面には複数の山部を並べて成るパターンが形成され、

該山部は、自らを通る直交2軸線のうちの少なくとも一方の軸線によって区分 される一方の側の立体形状と他方の側の立体形状とが互いに非対称であることを 特徴とする液晶装置。

【請求項13】 液晶を挟持する一対の基板と、観察側と反対側の前記基板の表面に形成された光反射膜とを有する液晶装置の製造方法において、

基材の表面に光反射膜を形成する工程と、

マスクを用いて前記光反射膜の表面に複数の山部を形成する工程とを有し、

前記複数の山部に対応する前記マスクのマスクパターンは、自らを通る直交 2 軸線の一方の軸線に沿った形状と、他方の軸線に沿った形状とが互いに異なることを特徴とする液晶装置用基板の製造方法。

【請求項14】 液晶を挟持する一対の基板と、観察側と反対側の前記基板の表面に形成された光反射膜とを有する液晶装置の製造方法において、

基材の表面に光反射膜を形成する工程と、

マスクを用いて前記光反射膜の表面に複数の山部を形成する工程とを有し、

前記複数の山部に対応する前記マスクのマスクパターンは、自らを通る直交 2 軸線のうちの少なくとも一方の軸線によって区分される一方の側の形状と他方の 側の形状とが互いに非対称であることを特徴とする液晶装置用基板の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、液晶装置の構成要素である液晶装置用基板及びその製造方法に関する。また、本発明は、液晶装置用基板を用いて構成される液晶装置及びその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】

近年、携帯電話機、携帯型パーソナルコンピュータ等といった電子機器に液晶

装置が広く用いられるようになってきている。この液晶装置の1つとして、反射型表示が可能な液晶装置が知られている。この液晶装置では、自然光や室内光等といった外部光が該液晶装置の内部へ取り込まれ、この光が該液晶装置の内部に設けた光反射膜で反射して再び外部へ出射することにより表示が行われる。

[0003]

この構成によれば、バックライトすなわち照明装置を用いなくても表示が出来 るので、消費電力を低く抑えることができる。また、バックライトを付設しない 場合には薄型化及び軽量化を達成できる。

[0004]

この反射型表示が可能な液晶装置においては、光反射膜の表面が鏡面状であると、観察者が視認する像に背景や室内照明が映ってしまい、表示された像が見難くなるという問題が生じる。この問題を解消するため、従来、上記光反射膜の表面に複数の微細な山部を形成して粗面化して、反射光を適度に散乱させるという技術が知られている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

上記従来の液晶装置用基板における光反射面の粗面化によってもたらされる反射光は、光量が上下左右の全領域で均一になるように設定されていた。例えば、図17に示すように、液晶装置用基板101に法線方向から光R0を照射すると共に、ディテクタ例えばフォトマルチメータ102を直交2軸線であるX軸線及びY 軸線の各方向へ移動させながら、反射光R1の光量を測定した所、図18に示すように、X 軸線方向における-90°~+90° の範囲の反射光量プルファイル Q_X と、Y 軸線方向における-90°~+90° の範囲の反射光量プロファイル Q_Y とは同じプロファイルとなっていた。

[0006]

上記のような方向性の無い反射光は、液晶装置において均一な明るさの像を表示させるという観点から見れば有効であるが、液晶装置の表示面を常に特定の1つの方向から観察するような場合には、不要な視野角方向に光が供給される分だけ、光が無駄に費やされていたと考えられる。

[0007]

本発明は、上記の問題点に鑑みて成されたものであって、反射光が不要な視野 角方向へ進行することを防止して、希望する視野角方向へ向かう反射光の光量を 増大させることにより、希望の方向から見たときの表示の明るさを増大させるこ とを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】

(1)まず、本発明を原理的に説明する。今、図14(a)及び図14(b)に示すように基材81の表面に光反射膜82を形成し、その光反射膜82の表面に正四角柱形状すなわち正ピラミッド形状の複数の山部10をドットマトリクス状に配列した構造の基板80を考える。この場合、山部10は図15(a)に示すように、平面断面下が正方形状で直交2軸線であるX軸線及びY軸線の両方に関して対称な形状であるとする。また、図15(a)において山部10の4つの側面を"A"、"B"、"C"及び"D"と呼び、また山部10が載っている基材表面を"E"と呼ぶことにする。

[0009]

図14(b)に矢印Aで示すように、複数の山部10を形成した光反射膜82に対して光を照射したとき、図15(a)のY軸線方向に関する反射光量の分布を測定すると、図16に示すように、面積の広い平面Eに対応して光量の大きい反射光eが発生し、側面A及び側面Bに対応して適宜の角度、例えば±30°の所にそれらの面積に対応した光量の反射光a及びcが発生する。この光量分布はX軸線方向に関しても全く同じであり、この結果、図14(a)の基板80に光を照射すると、立体空間の全方位に方向性の無い均一な反射光が得られる。

[0010]

次に、図15(a)における山部10の側面AをY軸線方向の外側へ伸ばした形状の図15(b)に示すような山部10eを考える。すると、この山部10eに関しては側面A'の基材25に対する傾斜角度θ2は側面Cの傾斜角度θ1よりも小さくなり、さらに側面A'の面積は山部10における側面Aの面積よりも大きくなる。従って、この山部10eに光が照射されると、図16において、3

0°よりも小さい視野角度、例えば15°の視野角度の所に側面Aの場合よりも 光量が少し大きい反射光a'が現れ、さらに、平面Eは面積が狭くなるので反射 光e'はそれに対応して反射光の光量が少し小さくなる。

[0011]

つまり、山部10の形状をY軸線方向に変形させてX軸線に関して非対称の形にすると、Y軸線方向に関して特定の不要な視野角方向の反射光量を低減すると同時に、特定の希望する視野角方向の反射光量を意図的に増大させることができる。この結果、例えば本基板80を液晶装置の反射板として用いる場合を考えれば、観察者による視認方向以外の視野角方向の明るさを抑えた上で、観察者が見る視野角方向の明るさだけを意図的に強めることができる。

[0012]

(2) 本発明は上記のような原理に基づいて成されたものであって、本発明に係る第1の液晶装置用基板は、液晶を挟持する一対の基板のうち観察側と反対側に位置する液晶装置用基板であって、基材と、該基材の表面に形成された光反射膜とを有し、該光反射膜の表面には複数の山部を並べて成るパターンが形成され、該山部は自らを通る直交2軸線の一方の軸線に沿った立体形状と、他方の軸線に沿った立体形状とが互いに異なることを特徴とする。

[0013]

例えば、光反射膜の表面に多数のドットパターンとして形成する山部は、図11(a)に示すように平面断面が長方形状で例えばX軸線方向に長いドーム型の山部10aや、図11(b)に示すように平面断面が長方形状で例えばX軸線方向に長い四角形状すなわちピラミッド形状の山部10bや、図12(c)に示すように平面断面が長円形状で例えばX軸線方向に長いドーム型の山部10cや、図12(d)に示すように平面形状が液滴形状の山部10d等のように形成できる。

[0014]

上記構成の第1の液晶装置用基板によれば、光反射膜は入射した光を立体空間 の全方位へ均一に反射するのではなく、特定の視野方向の光量又は強度が強くな るように反射する。これにより、反射光が不要な視野角方向へ進行することを防 止して、希望する視野角方向へ向かう反射光の光量を増大させることができ、希望の方向から見たときの表示の明るさを増大させることができる。

[0015]

(3) 次に、本発明に係る第2の液晶装置用基板は、液晶を挟持する一対の 基板のうち観察側と反対側に位置する液晶装置用基板であって、基材と、該基材 の表面に形成された光反射膜とを有し、該光反射膜の表面には複数の山部を並べ て成るパターンが形成され、該山部は自らを通る直交2軸線のうちの少なくとも 一方の軸線によって区分される一方の側の立体形状と他方の側の立体形状とが互 いに非対称であることを特徴とする。

[0016]

例えば、光反射膜の山部は、図15(b)に示すように、1つの側面A'が対向する側面Cよりも面積が広く且つ基材25に対する傾斜角度が側面Cよりも小さい大きさの角柱形状すなわちピラミッド形状10eとすることができる。この形状では、X軸線によって区分される左部の立体形状と右部の立体形状とが互いに非対称になっている。

[0017]

また、光反射膜の山部は、図12(d)に示すように、一方の軸線であるY軸線によって区分される上部の立体形状と下部の立体形状とが互いに非対称となるように形成することもできる。

[0018]

上記構成の第2の液晶装置用基板によれば、光反射膜は入射した光を立体空間の全方位へ均一に反射するのではなく、特定の方向の光量又は強度が強くなるように反射する。これにより、反射光が不要な視野角方向へ進行することを防止して、希望する視野角方向へ向かう反射光の光量を増大させることができ、希望の方向から見たときの表示の明るさを増大させることができる。

[0019]

上記第2の液晶装置用基板において、軸線によって区分される部分の立体形状 を該軸線に関して非対称にするという構成要件は、例えば、面積に関して非対称 にしたり、基材に対する角度に関して非対称にしたりする等といった具体例が考 えられる。面積に関して非対称にすることは、例えば図15(b)の山部10eのようにX軸線の左側面Cの面積と右側面A の面積とを異ならせることによって実現できる。また、角度に関して非対称にすることは、例えば図15(b)の山部10eのようにX軸線の左側面Cの基板25に対する角度 θ 1と右側面A の基板25に対する角度 θ 2とを異ならせることによって実現できる。

[0020]

次に、上記第1及び第2の液晶装置用基板においては、山部の形状を特定するための直交2軸線の少なくとも一方が前記基材の端辺に平行であることが望ましい。これにより、複数の山部の配列から成る光散乱パターンの基材に対する配置が一義的に決められ、その結果、基材をどの方向から見れば明るい表示となるかに関する判断が容易にできるようになる。

[0021]

(4) 次に、本発明に係る第3の液晶装置用基板は、液晶を挟持する一対の基板のうち観察側と反対側に位置する液晶装置用基板であって、基材と、該基材の表面に形成された光反射膜とを有し、該光反射膜の表面には複数の山部を並べて成る光反射パターンが形成され、該光反射パターンで反射する光の光量に関して、前記山部を通る直交2軸線の一方に沿った光量プロファイルと、直交2軸線の他方に沿った光量プロファイルとが互いに異なることを特徴とする。

[0022]

この第3の液晶装置用基板によれば、光反射膜は入射した光を立体空間の全方位へ均一に反射するのではなく、特定の方向の光量又は強度が強くなるように反射する。これにより、反射光が不要な視野角方向へ進行することを防止して、希望する視野角方向へ向かう反射光の光量を増大させることができ、希望の方向から見たときの表示の明るさを増大させることができる。

[0023]

例えば、図17に示す測定系で反射光の光量を測定したとき、得られるプロファイルが図13に示すように、一方の軸線に沿った光量プロファイル Q_X は山形状であり、前記他方の軸線に沿った光量プロファイル Q_Y は直線状であるといったような特性を有する光反射パターンにより、上記第3の液晶装置用基板を

実現できる。

[0024]

図13に示す特性を有する液晶装置用基板を用いれば、Y方向に沿って目を移動させたときには、中央部が明るく両端部が暗い表示が視認できる。一方、X方向に沿って目を移動させたときには、一方の端部から他方の端部にわたって均一な明るさの表示を見ることができる。X方向に沿った見え方とY方向に沿った見え方とを比べれば、X方向に沿った見え方は両端部側、すなわち低角度側から表示面を見たときの明るさが増大する。

[0025]

(5) 次に、本発明に係る第1の液晶装置用基板の製造方法は、液晶を挟持する一対の基板のうち観察側と反対側に位置する液晶装置用基板の製造方法において、基材の表面に光反射膜を形成する工程と、マスクを用いて前記光反射膜の表面に複数の山部を形成する工程とを有し、前記複数の山部に対応する前記マスクのマスクパターンは、自らを通る直交2軸線の一方の軸線に沿った形状と、他方の軸線に沿った形状とが互いに異なることを特徴とする。この第1の液晶装置用基板の製造方法によれば、上記第1の液晶装置用基板を確実に製造することができる。

[0026]

(6) 次に、本発明に係る第2の液晶装置用基板の製造方法は、液晶を挟持する一対の基板のうち観察側と反対側に位置する液晶装置用基板の製造方法において、基材の表面に光反射膜を形成する工程と、マスクを用いて前記光反射膜の表面に複数の山部を形成する工程とを有し、前記複数の山部に対応する前記マスクのマスクパターンは、自らを通る直交2軸線のうちの少なくとも一方の軸線によって区分される一方の側の形状と他方の側の形状とが互いに非対称であることを特徴とする。この第2の液晶装置用基板の製造方法によれば、上記第2の液晶装置用基板を確実に製造することができる。

[0027]

(7) 次に、本発明に係る第1の液晶装置は、液晶を挟持する一対の基板と 、観察側と反対側の前記基板の表面に形成された光反射膜とを有する液晶装置に おいて、該光反射膜の表面には複数の山部を並べて成るパターンが形成され、該 山部は自らを通る直交 2 軸線の一方の軸線に沿った立体形状と、他方の軸線に沿った立体形状とが互いに異なることを特徴とする。

[0028]

この第1の液晶装置によれば、光反射膜に入射した光を立体空間の全方位へ均一に反射するのではなく、特定の視野角方向の光量又は強度が強くなるように反射できるので、反射光が不要な視野角方向へ進行することを防止して、希望する視野角方向へ向かう反射光の光量を増大させることができ、これにより、液晶の配向制御によって形成される像を見ることに関して、不要な視野角方向については暗く表示する一方で、希望の視野角方向から見たときの表示の明るさを増大させることができる。

[0029]

(8) 次に、本発明に係る第2の液晶装置は、液晶を挟持する一対の基板と、観察側と反対側の前記基板の表面に形成された光反射膜とを有する液晶装置において、該光反射膜の表面には複数の山部を並べて成るパターンが形成され、該山部は自らを通る直交2軸線のうちの少なくとも一方の軸線によって区分される一方の側の立体形状と他方の側の立体形状とが互いに非対称であることを特徴とする。

[0030]

この第2の液晶装置によれば、光反射膜に入射した光を立体空間の全方位へ均一に反射するのではなく、特定の視野角方向の光量又は強度が強くなるように反射できるので、反射光が不要な視野角方向へ進行することを防止して、希望する視野角方向へ向かう反射光の光量を増大させることができ、これにより、液晶の配向制御によって形成される像を見ることに関して、不要な視野角方向については暗く表示する一方で、希望の視野角方向から見たときの表示の明るさを増大させることができる。

[0031]

(9) 次に、本発明に係る第1の液晶装置の製造方法は、液晶を挟持する一対の基板と、観察側と反対側の前記基板の表面に形成された光反射膜とを有する

液晶装置の製造方法において、基材の表面に光反射膜を形成する工程と、マスクを用いて前記光反射膜の表面に複数の山部を形成する工程とを有し、前記複数の山部に対応する前記マスクのマスクパターンは、自らを通る直交 2 軸線の一方の軸線に沿った形状と、他方の軸線に沿った形状とが互いに異なることを特徴とする。この第1の液晶装置の製造方法によれば、上記第1の液晶装置を確実に製造することができる。

[0032]

(10) 次に、本発明に係る第2の液晶装置の製造方法は、液晶を挟持する一対の基板と、観察側と反対側の前記基板の表面に形成された光反射膜とを有する液晶装置の製造方法において、基材の表面に光反射膜を形成する工程と、マスクを用いて前記光反射膜の表面に複数の山部を形成する工程とを有し、前記複数の山部に対応する前記マスクのマスクパターンは、自らを通る直交2軸線のうちの少なくとも一方の軸線によって区分される一方の側の形状と他方の側の形状とが互いに非対称であることを特徴とする。この第2の液晶装置の製造方法によれば、上記第2の液晶装置を確実に製造することができる。

[0033]

【発明の実施の形態】

以下、本発明を実施形態に基づいてより具体的に説明する。

[0034]

(第1実施形態)

図1及び図2は、本発明に係る液晶装置用基板を用いた本発明に係る液晶装置の一実施形態の主要部、特に1つの画素部分を拡大して示している。この液晶装置の全体構造は例えば図3に示すように設定できる。

[0035]

本実施形態に係る液晶装置は、アクティブ素子として3端子型の能動素子であるTFT (Thin Film Transistor)を用いたアクティブマトリクス方式の液晶装置であり、自然光等といった外部光を用いて表示を行う方式の反射型液晶装置であり、そして液晶駆動用ICを基板上に直接に実装する方式のCOG (Chip On Glass)方式の液晶装置である。

[0036]

図3において、液晶装置1は第1基板2aと第2基板2bとをそれらの周辺部において環状のシール材3によって貼り合わせ、さらに、第1基板2a、第2基板2b及びシール材3によって囲まれる間隙すなわちセルギャップ内に液晶を封入することによって形成される。また、本実施形態では、一方の基板2aの表面に液晶駆動用IC4a及び4bが直接に実装されている。

[0037]

第1基板2aのシール材3によって囲まれる内部領域には、複数の画素電極が 行方向XX及び列方向YYに関してドットマトリクス状の配列で形成される。ま た、第2基板2bのシール材3によって囲まれる内部領域には、無パターンの面 状電極が形成され、その面状電極が第1基板2a側の複数の画素電極に対向して 配置される。

[0038]

第1基板2a上の1つの画素電極と第2基板2b上の面状電極によって液晶を挟んだ部分が1つの画素を形成し、この画素の複数個がシール材3によって囲まれる内部領域内でドットマトリクス状に配列することによって表示領域Vが形成される。液晶駆動用IC4a及び4bは複数の画素を形成している対向電極間に選択的に走査信号及びデータ信号を印加することにより、液晶の配向を画素毎に制御する。この液晶の配向制御により該液晶を通過する光が変調されて、表示領域V内に文字、数字等といった像が表示される。

[0039]

図1は、液晶装置1において表示領域Vを構成する複数の画素のうちの1つの 断面構造を拡大して示している。また、図2は、その画素の平面構造を示してい る。なお、図1は図2におけるI-I線に従った断面構造を示している。

[0040]

図1において、第1基板2aは、ガラス、プラスチック等によって形成された 基材6aと、その基材6a上に形成されたスイッチング素子として機能するアク ティブ素子としてのTFT (Thin Film Transistor) 7と、有機絶縁膜8を挟ん でTFT7の上層に形成された画素電極9とを有する。画素電極9の上には配向 膜11 aが形成され、この配向膜11 aに対して配向処理としてのラビング処理が施される。画素電極9は、例えばA1 (アルミニウム)、Ag(銀)等といった光反射性の導電材料によって形成される。

[0041]

第1基板2aに対向する第2基板2bは、ガラス、プラスチック等によって形成された基材6bと、その基材6b上に形成されたカラーフィルタ12と、そのカラーフィルタ12の上に形成された透明な電極13と、その電極13の上に形成された配向膜11bとを有する。電極13は、ITO (Indium Tin Oxide) 等によって基材6bの表面全域に形成された面電極である。

[0042]

カラーフィルタ12は、第1基板2a側の画素電極9に対向する位置にR(赤),G(緑),B(青)又はC(シアン),M(マゼンタ),Y(イエロー)等といった各色のいずれかの色フィルタエレメント12aを有し、画素電極9に対向しない位置にブラックマスク12bを有する。

[0043]

図1において、第1基板2aと第2基板2bとの間の間隔、すなわちセルギャップはいずれか一方の基板の表面に分散された球状のスペーサ14によって寸法が維持され、そのセルギャップ内に液晶Lが封入される。

[0044]

TFT7は、基材6a上に形成されたゲート電極16と、このゲート電極16 の上で基材6aの全域に形成されたゲート絶縁膜17と、このゲート絶縁膜17 を挟んでゲート電極16の上方位置に形成された半導体層18と、その半導体層18の一方の側にコンタクト電極19を介して形成されたソース電極21と、さらに半導体層18の他方の側にコンタクト電極19を介して形成されたドレイン電極22とを有する。

[0045]

図2に示すように、ゲート電極16はゲートバス配線23から延びている。また、ソース電極21はソースバス配線24から延びている。ゲートバス配線23 は基材6aの横方向に延びていて縦方向へ等間隔で平行に複数本形成される。ま た、ソースバス配線24はゲート絶縁膜17(図1参照)を挟んでゲートバス配線23と交差するように縦方向へ延びていて横方向へ等間隔で平行に複数本形成される。

[0046]

ゲートバス配線23は図3の液晶駆動用IC4a及び4bの一方に接続されて例えば走査線として作用し、他方、ソースバス配線24は液晶駆動用IC4a及び4bの他方に接続されて例えば信号線として作用する。また、画素電極9は、図2に示すように、互いに交差するゲートバス配線23とソースバス配線24とによって区画される方形領域のうちTFT7に対応する部分を除いた領域を覆うように形成される。

[0047]

ゲートバス配線 23 及びゲート電極 16 は、例えばクロム、タンタル等によって形成される。ゲート絶縁膜 17 は、例えば窒化シリコン(SiN_X)、酸化シリコン(SiO_X)等によって形成される。半導体層 19 は、例えばa-S i、多結晶シリコン、CdSe 等によって形成される。コンタクト電極 19 は、例えばa-Si 等によって形成される。ソース電極 21 及びそれと一体なソースバス配線 24 並びにドレイン電極 22 は、例えばチタン、モリブデン、アルミニウム等によって形成される。

[0048]

図1に示す有機絶縁膜8は、ゲートバス配線23、ソースバス配線24及びTFT7を覆って基材6a上の全域に形成されている。但し、有機絶縁膜8のドレイン電極22に対応する部分にはコンタクトホール26が形成され、このコンタクトホール26の所で画素電極9とTFT7のドレイン電極22との導通がなされている。有機絶縁膜8のうち画素電極9が形成される領域には、例えば、図12(c)に示すような長円形状でドーム形状の山部10cが互いに微小間隔で規則的に、本実施形態では規則的なマトリクス状の配列となるように形成されている。この結果、有機絶縁膜8の上に積層される画素電極9も同様にして複数の山部10cの配列から成る光反射パターンを有することになる。

[0049]

上記の山部10cは、図2において、ソースバス配線24の延在方向であるX 軸線方向を長軸とし、それと直角なY軸線方向を短軸となるように配列されてい る。また、山部10cの長軸方向Xは図3において基材6aのXX方向の端辺に 対して平行に設定され、短軸方向Yは基材6aのYY方向の端辺に対して平行に 設定されている。このように、山部10cを規定するX, Y軸線方向と液晶装置 1の基板6a等の端辺方向XX, YYとの間に関連付けをしておけば、どの視野 角度方向から液晶装置1の表示領域Vを見たときに明るい表示を見ることができ るかを、容易に判断できる。

[0050]

本実施形態の液晶装置1は以上のように構成されているので、図1において、 観察者側すなわち第2基板2b側から液晶装置1の内部へ入った外部光は、液晶 Lを通過して光反射性材料によって形成された画素電極9に到達し、該電極9で 反射して再び液晶Lへ供給される。液晶Lは、走査信号及びデータ信号によって 選択される画素電極9と対向電極13との間に印加される電圧によって画素毎に その配向が制御され、これにより、液晶Lに供給された反射光は画素毎に変調され、これにより観察者側に文字、数字等といった像が表示される。

[0051]

本実施形態では、光反射膜として作用する画素電極9の表面に複数の山部10 cを規則的に配列して成る反射パターンが形成されると共に、それら複数の山部10 cはX軸線に沿った立体形状とY軸線に沿った立体形状とが互いに異なっているので、一定の視野角方向への反射光量を低く抑えた上で、別の特定の視野角方向への反射光量を増大させることができる。この結果、観察者は、液晶装置1の表示領域V内に表示される像を特定の視野角方向から非常に明るい表示として観察できる。

[0052]

図4は、図1等に示した液晶装置1の製造方法を工程順に示している。この工程図に基づいて液晶装置1の製造方法を説明すれば、まず、工程P1において第1基板2a(図1参照)を作製し、工程P2において第2基板2bを作製する。通常の製造工程では、図3に示す液晶装置1の1個分の第1基板2a及び第2基

板2bを1個ずつ作製するのではなく、1つの大面積の基材、いわゆるマザーボードの表面に液晶装置の複数個分の第1基板2aを形成し、他の1つのマザーボードの表面に液晶装置の複数個分の第2基板2bを形成する。

[0053]

その後、複数の第1基板パターンが形成された第1基板マザーボードと、複数の第2基板パターンが形成された第2基板マザーボードとを互いに位置合わせ、すなわちアライメントした状態でシール材3によって貼り合わせて、大面積の空のパネル構造を形成する(工程P3)。次に、各液晶装置1内のシール材3の一部に形成された液晶注入口3a(図3参照)が外部に露出するように、上記大面積のパネル構造をブレイクすなわち切断して、いわゆる短冊状のパネル構造を形成する(工程P4)。

[0054]

次に、作製された短冊状のパネル構造の液晶注入口3 a からパネル構造の内部に液晶を注入し、さらに注入完了後の液晶注入口3 a を樹脂によって封止する(工程P5)。その後、液晶封入後の短冊状のパネル構造を図3に示すような1個の液晶装置1の大きさにブレイクすなわち切断し(工程P6)、さらに液晶駆動用IC4 a 及び4 b を一方の基板の表面に実装する(工程P7)。これにより、図3の液晶装置1が完成する。

[0055]

上記のような液晶装置の製造方法において、特に、第1基板形成工程P1は例えば図5に示す製造方法によって実現される。具体的には、工程P11及び図6(a)において、ガラス等から成る基材6aの上に、例えばスパッタリング法によってタンタル金属膜を形成し、この金属膜を例えばフォトリソグラフィー法によってパターニングして、ゲートバス配線23及びそれと一体なゲート電極16を形成する。

[0056]

次に、工程P12及び図6(a)において、例えばプラズマCVD法によって 窒化シリコンから成るゲート絶縁膜17を形成する。次に、工程P13及び図6 (a)において、半導体層18となるa-Si層と、コンタクト電極19となる n^+ 型a-Si層とをこの順で連続的に形成し、さらに、形成された n^+ 型a-Si層及びa-Si層のパターニングを行って半導体層 18及びコンタクト電極 19とを形成する。

[0057]

次に、工程P14及び図6(a)において、基材6aの表面の全域に例えばモリブデン金属をスパッタ法によって形成し、このモリブデン金属層のパターニングを行って、ソース電極21、ドレイン電極22及びソースバス配線24を形成し、これによりTFT7が完成する。次に、工程P15及び図6(b)において、TFT7を形成した基材6a上の全面に例えばポリイミド樹脂をスピンコートして有機絶縁膜8を形成する。

[0058]

次に、工程16及び図6(b)において、フォトリソグラフィー法を用いて有機絶縁膜8にコンタクトホール26を形成する。次に、工程P17及び図6(c)において、有機絶縁膜8の上にフォトレジスト27を塗布し、図7に示すようなマスク28を用いて画素電極9の形成領域のフォトレジスト27をパターニングする。このときに用いるマスク28にはX軸線方向に長軸を有し、それと直角なY軸線方向に短軸を有する長円形状のマスクパターン29を有する。

[0059]

次に、工程18及び図6(d)において、フォトレジスト27の無い部分の有機絶縁膜8をエッチングによって除去して規則的に並ぶ山部10cを形成する。このとき、コンタクトホール26及びTFT7の上の有機絶縁膜8はフォトレジスト27によって保護されてエッチングによって除去されない。エッチング処理後、フォトレジスト27は薬品や光照射によって除去される。

[0060]

その後、工程P19及び図6(e)において、有機絶縁膜8の上の全域にアルミニウム層を形成し、さらにパターニングして光反射膜を兼ねる画素電極38を形成する。このとき、画素電極38の下地となる有機絶縁膜8の表面に山部10cのパターンが形成されているので、画素電極38も同様の山部10cを有するパターン、すなわち光反射パターンを有することになる。画素電極38は有機絶

縁膜26に形成されたコンタクトホール26を介してTFT7のドレイン電極2 2に接続される。

[0061]

その後、工程P20において基材8の表面の全域にポリイミド樹脂を塗布及び焼成することによって配向膜11a(図1参照)を形成し、それにラビング処理を施し、さらに工程P21においてスクリーン印刷等を用いてシール材3(図3参照)を形成し、さらに工程P22においてスペーサ14(図1参照)を分散し、これにより第1基板2aが完成する。

[0062]

なお、以上の実施形態では図7のマスクパターン29として図12(c)に示す断面長円形ドーム形状の山部10cを形成できるパターンを用いたが、これに代えて、図11(a)に示す断面長方形ドーム形状や、図11(b)に示す断面長方形ピラミッド形状や、図12(d)に示す液滴ドーム形状や、図15(b)に示す断面長方形で偏形のピラミッド形状や、図13に示すように直交2軸線方向で光量分布が異なるような形状を採用することができる。

[0063]

(第2実施形態)

図8は、本発明に係る液晶装置用基板を用いた本発明に係る液晶装置の他の実施形態の主要部、特に数個の画素部分を拡大して示している。この液晶装置の全体構造は例えば図3に示すように設定できる。

[0064]

本実施形態に係る液晶装置は、アクティブ素子として2端子型の能動素子であるTFD(Thin Film Diode)を用いたアクティブマトリクス方式の液晶装置であり、自然光等といった外部光を用いた反射表示と照明装置を用いた透過表示を選択的に行うことができる方式の半透過反射型液晶装置であり、そして液晶駆動用ICを基板上に直接に実装する方式のCOG(Chip On Glass)方式の液晶装置である。

[0065]

本実施形態においても液晶装置1は、図3において、第1基板2aと第2基板

2 b とをシール材 3 によって貼り合わせ、さらに、第 1 基板 2 a 、第 2 基板 2 b 及びシール材 3 によって囲まれる間隙すなわちセルギャップ内に液晶を封入することによって形成される。また、一方の基板 2 a の表面に液晶駆動用 I C 4 a 及び 4 b が直接に実装されている。

[0066]

第2基板2bのシール材3によって囲まれる内部領域には、複数の画素電極が 行方向XX及び列方向YYに関してドットマトリクス状の配列で形成される。ま た、第1基板2aのシール材3によって囲まれる内部領域にはストライプ状の電 極が形成され、そのストライプ状電極が第2基板2b側の複数の画素電極に対向 して配置される。

[0067]

第1基板2a上のストライプ状電極と第2基板2b上の1つの画素電極によって液晶を挟んだ部分が1つの画素を形成し、この画素の複数個がシール材3によって囲まれる内部領域内でドットマトリクス状に配列することによって表示領域 Vが形成される。液晶駆動用IC4a及び4bは複数の画素内の対向電極間に選択的に走査信号及びデータ信号を印加することにより、液晶の配向を画素毎に制御する。この液晶の配向制御により該液晶を通過する光が変調されて、表示領域 V内に文字、数字等といった像が表示される。

[0068]

図8は、液晶装置1において表示領域Vを構成する複数の画素のうちの数個の 断面構造を拡大して示している。また、図9は、1つの画素部分の断面構造を示 している。

[0069]

図8において、第1基板2aは、ガラス、プラスチック等によって形成された基材6aと、その基材6aの内側表面に形成された光反射膜31と、その光反射膜31の上に形成されたカラーフィルタ12と、そのカラーフィルタ12の上に形成された透明なストライプ状電極13とを有する。そのストライプ状電極13の上には図9に示すように配向膜11aが形成される。この配向膜11aに対して配向処理としてのラビング処理が施される。ストライプ状電極13は、例えば

IT〇 (Indium Tin Oxide) 等といった透明な導電材料によって形成される。

[0070]

第1基板2aに対向する第2基板2bは、ガラス、プラスチック等によって形成された基材6bと、その基材6bの内側表面に形成されたスイッチング素子として機能するアクティブ素子としてのTFD (Thin Film Diode) 37と、TFD37に接続された画素電極9とを有する。TFD37及び画素電極9の上には図9に示すように配向膜11bが形成され、この配向膜11bに対して配向処理としてのラビング処理が施される。画素電極9は、例えばITO (Indium Tin 0 xide) 等といった透明な導電材料によって形成される。

[0071]

第1基板2aに属するカラーフィルタ12は、第2基板2b側の画素電極9に対向する位置にR(赤),G(緑),B(青)又はC(シアン),M(マゼンタ),Y(イエロー)等といった各色のいずれかの色フィルタエレメント12aを有し、画素電極9に対向しない位置にブラックマスク12bを有する。

[007.2]

図9において、第1基板2aと第2基板2bとの間の間隔、すなわちセルギャップはいずれか一方の基板の表面に分散された球状のスペーサ14によって寸法が維持され、そのセルギャップ内に液晶しが封入される。

[0073]

TFD37は、図9及び図10に示すように、第1金属層34と、その第1金属層34の表面に形成された絶縁層36と、その絶縁層36の上に形成された第2金属層38とによって構成されている。このようにTFD37は、第1金属層/絶縁層/第2金属層から成る積層構造、いわゆるMIM (Metal Insulator Metal) 構造によって構成されている。

[0074]

第1金属層34は、例えば、タンタル単体、タンタル合金等によって形成される。第1金属層34としてタンタル合金を用いる場合には、主成分のタンタルに、例えば、タングステン、クロム、モリブデン、レニウム、イットリウム、ランタン、ディスプロリウム等といった周期律表において第6~第8族に属する元素

が添加される。

[0075]

第1金属層34はライン配線39の第1層39aと一体に形成される。このライン配線39は画素電極9を間に挟んでストライプ状に形成され、画素電極9へ 走査信号を供給するための走査線又は画素電極9へデータ信号を供給するための データ線として作用する。

[0076]

絶縁層36は、例えば、陽極酸化法によって第1金属層34の表面を酸化することによって形成された酸化タンタル($\mathrm{Ta}_2\mathrm{O}_3$)によって構成される。なお、第1金属層34を陽極酸化したときには、ライン配線39の第1層39aの表面も同時に酸化されて、同様に酸化タンタルから成る第2層39bが形成される

[0077]

第2金属層38は、例えばCr等といった導電材によって形成される。画素電極9は、その一部が第2金属層38の先端に重なるように基材6bの表面に形成される。なお、基材6bの表面には、第1金属層34及びライン配線の第1層39aを形成する前に酸化タンタル等によって下地層を形成することがある。これは、第2金属層38の体積後における熱処理によって第1金属層34が下地から剥離しないようにしたり、第1金属層34に不純物が拡散しないようにしたりするためである。

[0078]

図8において、基材6aの外側表面には位相差板32aが貼着等によって装着され、さらにその位相差板32aの上に偏光板33aが貼着等によって装着される。また、基材6bの外側表面には位相差板32bが貼着等によって装着され、さらにその位相差板32bの上に偏光板33bが貼着等によって装着される。

[0079]

例えばSTN (Super Twisted Nematic) 液晶等を用いると、該液晶を通過する光に波長分散が発生して表示像に着色が発生することがある。位相差板32a及び32bはそのような着色を除去するために用いられる光学的異方体であり、

例えばポリビニルアルコール、ポリエステル、ポリエーテルアミド、ポリエチレン等といった樹脂を一軸延伸処理することによって形成されるフィルムによって 構成できる。

[0080]

偏光板33a及び33bは、自然光の入射に対してある一方向の直線偏光を出射する機能を有するフィルム状光学要素であり、例えば、偏光層をTAC(三酢酸セルロース)の保護層で挟むことによって形成できる。偏光板33a及び3bは、通常は、互いの透過偏光軸を異ならせて配置する。

[0081]

光反射膜31は、例えば、アルミニウム等といった光反射性の金属によって形成され、第2基板2bに属する各画素電極9に対応する位置、すなわち各画素に対応する位置に光透過用の開口41が形成される。また、光反射膜31の液晶側表面には、例えば、図12(c)に示すような長円形状でドーム形状の山部10cが互いに微小間隔で規則的に、本実施形態では規則的なマトリクス状の配列となるように形成されている。

[0082]

上記の山部10cは、ライン配線39の延在方向であるX軸線方向を長軸とし、それと直角なY軸線方向が短軸となるように配列されている。また、山部10cの長軸方向Xは図3において基材6aのXX方向の端辺に対して平行に設定され、短軸方向Yは基材6aのYY方向の端辺に対して平行に設定されている。

[0083]

本実施形態の液晶装置1は以上のように構成されているので、当該液晶装置1が反射型表示を行う場合には、図8において、観察者側すなわち第2基板2b側から液晶装置1の内部へ入った外部光は、液晶Lを通過して光反射膜31に到達し、該反射膜31で反射して再び液晶Lへ供給される。液晶Lは、画素電極9とストライプ状対向電極13との間に印加される電圧、すなわち走査信号及びデータ信号によって画素毎にその配向が制御され、これにより、液晶Lに供給された反射光は画素毎に変調され、これにより観察者側に文字、数字等といった像が表示される。



[0084]

他方、液晶装置1が透過型表示を行う場合には、第1基板2aの外側に配置された照明装置、いわゆるバックライト42が発光し、この発光が偏光板33a、位相差板32a、基材6a、光反射膜31の開口41、カラーフィルタ12、電極13及び配向膜11aを通過した後に液晶Lに供給される。この後、反射型表示の場合と同様にして表示が行われる。

[0085]

本実施形態では、光反射膜31の表面に複数の山部10cを規則的に配列して成る反射パターンが形成されると共に、それら複数の山部10cはX軸線に沿った立体形状とY軸線に沿った立体形状とが互いに異なっているので、一定の視野角方向への反射光量を低く抑えた上で、別の特定の視野角方向への反射光量を増大させることができる。この結果、観察者は、光反射膜31を用いて行われる反射型表示の際に、液晶装置1の表示領域V内に表示される像を特定の視野角方向に関して非常に明るい表示として観察できる。

[0086]

本実施形態の液晶装置1は、既に説明した図4に示す製造方法によって製造することができる。また、第1基板2a及び第2基板2bの形成方法も従来周知の方法を採用できる。なお、図8において第1基板2aの表面に光反射膜31を形成し、さらにその光反射膜に開口41及び反射パターンとしての山部10cを形成する際には、例えば、図7に示すような長円形状のマスクパターン29を縦横のマトリクス状に配列して成るマスク28を用いて行われるフォトリソグラフィー法を採用することができる。

[0087]

なお、上記実施形態では図7のマスクパターン29として図12(c)に示す 平面断面が長円形状でドーム形状の山部10cを形成できるパターンを用いたが、これに代えて、図11(a)に示すような平面断面が長方形状でドーム形状の山部10aや、図11(b)に示すような平面断面が長方形状でピラミッド形状の山部10bや、図12(d)に示すような液滴ドーム形状の山部10dや、図15(b)に示すような平面断面が長方形状で偏ったピラミッド形状の山部や、

2 3



図13に示すように直交2軸線方向で光量分布が異なるような山部等を形成できる各種パターンを採用することができる。

[0088]

(その他の実施形態)

以上、好ましい実施形態を挙げて本発明を説明したが、本発明はその実施形態 に限定されるものでなく、請求の範囲に記載した発明の範囲内で種々に改変でき る。

[0089]

例えば、以上に説明した実施形態では反射パターンを構成する山部を規定する 直交2軸を液晶装置1の基板の端辺方向XX及びYYに平行となるように設定し たが、これに代えて、反射パターンに関する直交2軸方向と基板の端辺方向とに 適宜の角度を持たせても良い。

[0090]

また、図3に示した液晶装置1は単なる例示であり、本発明に係る液晶装置用 基板を適用できる液晶装置は図3に示す構造以外の任意の液晶装置とすることが できる。

[0091]

【発明の効果】

本発明に係る液晶装置用基板及び液晶装置並びにそれらの製造方法によれば、液晶装置の内部に入射した光を光反射膜によって反射させる際に、立体空間の全方位へ均一に反射するのではなく、特定の視野方向の光量又は強度が強くなるように反射できる。これにより、反射光が不要な視野角方向へ進行することを防止して、希望する視野角方向へ向かう反射光の光量を増大させることができ、これにより、希望の方向から見たときの表示の明るさを増大させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明に係る液晶装置用基板の一実施形態及びその液晶装置用基板を用いて構成される液晶装置の一実施形態の主要部の断面構造を示す断面図である。

【図2】

図1で用いられる液晶装置用基板の主要部の平面図である。

【図3】

本発明に係る液晶装置の一実施形態を示す斜視図である。

【図4】

本発明に係る液晶装置の製造方法の一実施形態を示す工程図である。

【図5】

本発明に係る液晶装置用基板の製造方法の一実施形態を示す工程図である。

【図6】

図5に示す工程図に対応する基板の形成手順を示す図である。

【図7】

図5の製造方法で用いられるマスクの一例を示す平面図である。

【図8】

本発明に係る液晶装置用基板の他の実施形態及びその液晶装置用基板を用いて 構成される液晶装置の他の実施形態の主要部の構造を示す斜視図である。

【図9】

図8の主要部の断面構造を示す断面図である。

[図10]

図8の液晶装置で用いられるアクティブ素子の一例であるTFD素子を示す斜 視図である。

【図11】

光反射膜の表面に形成する山部の例を示す図である。

【図12】

光反射膜の表面に形成する山部の他の例を示す図である。

【図13】

光反射膜の表面に形成する山部によってもたらされる反射光の光量分布の一例 を示すグラフである。

【図14】

従来の液晶装置用基板の一例を示す図である。

【図15】

本発明に係る液晶装置用基板に形成する山部を説明するための図である。

【図16】

図15に示す山部を備えた反射パターンによってもたらされる反射光の光量分 布の一例を示すグラフである。

【図17】

反射光の光量分布を測定するための測定系の一例を示す斜視図である。

【図18】

図17の測定系を用いて得られる反射光の光量分布の従来の一例を示すグラフ である。

【符号の説明】

L

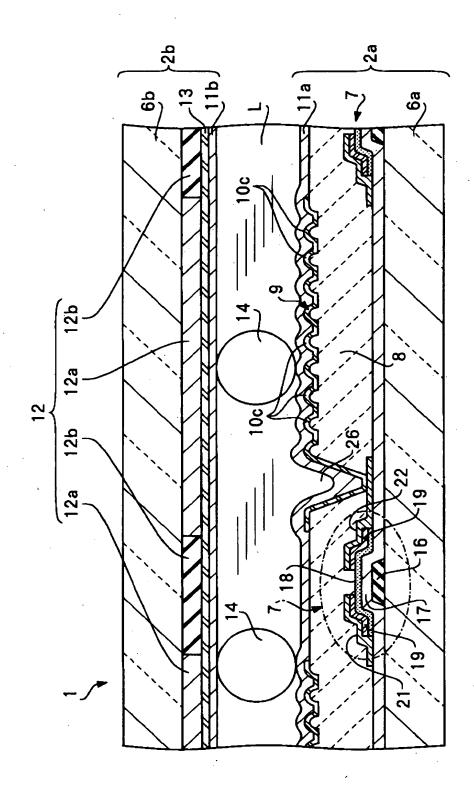
	1		液晶装置
	2 a,	2 b	基板
	3		シール材
	4 a,	4 b	液晶駆動用IC
	6 a,	6 b	基板
	7		TFT
	8		有機絶縁膜
	9		画素電極
1	0 a.	10b,	10c, 10d, 10e 山部
1	3		電極
2	8		マスク
2	9		マスクパターン
3	1		光反射膜
3	7		TFD
			-

液晶

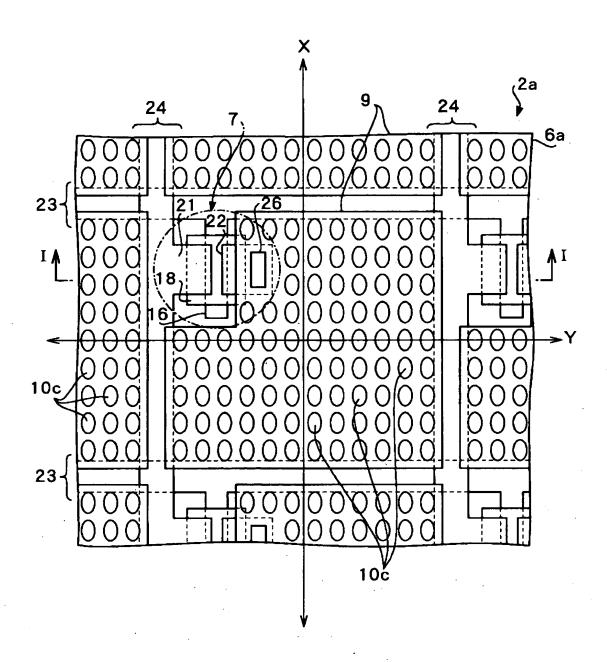
【書類名】

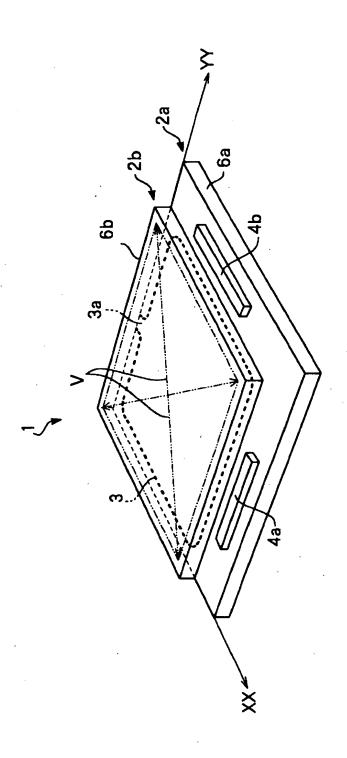
図面

【図1】

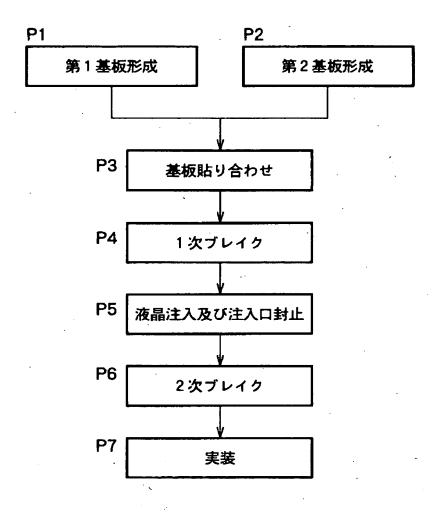


【図2】

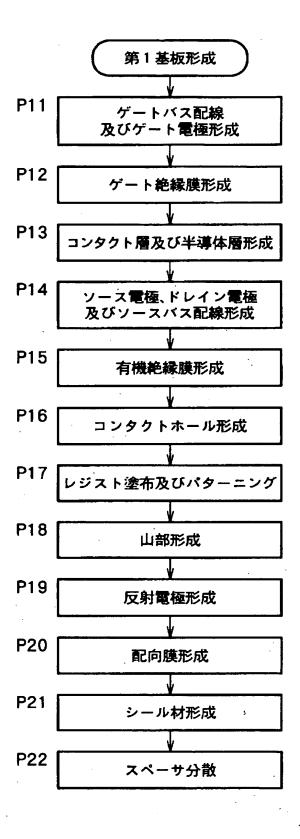




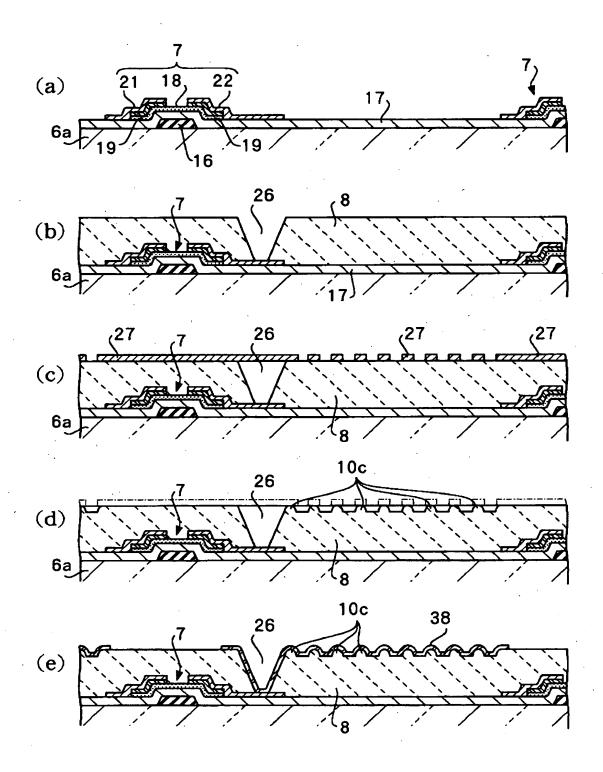
【図4】



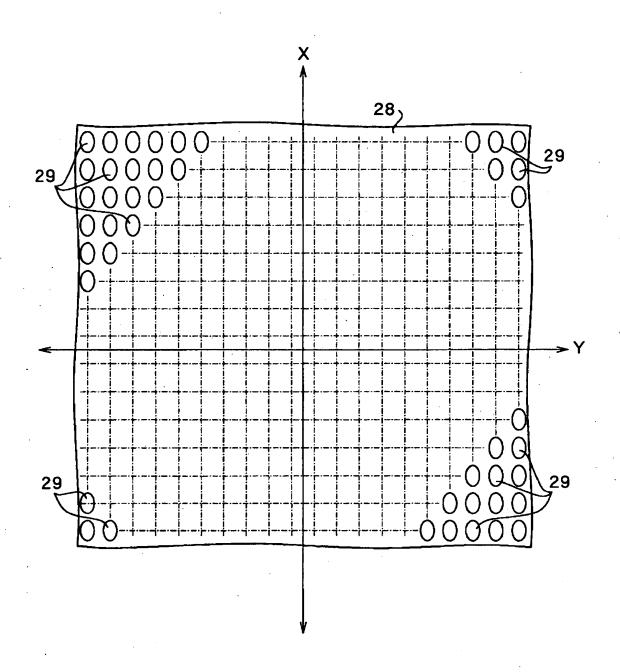
【図5】



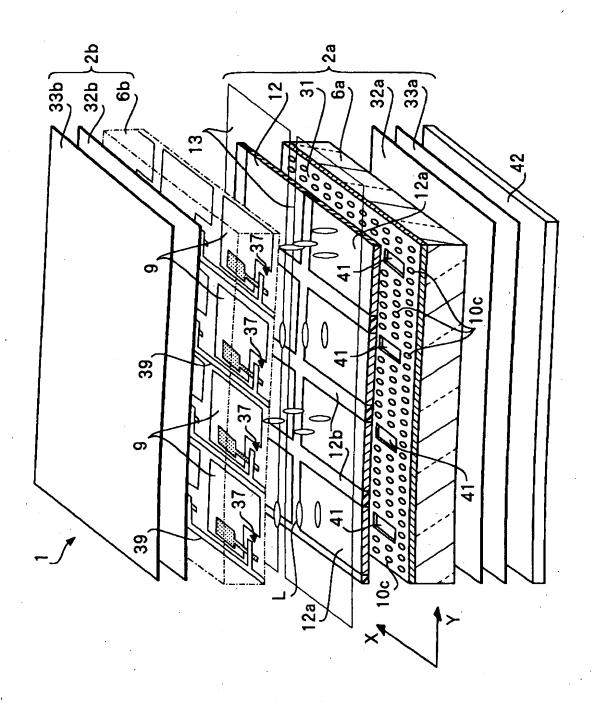
【図6】



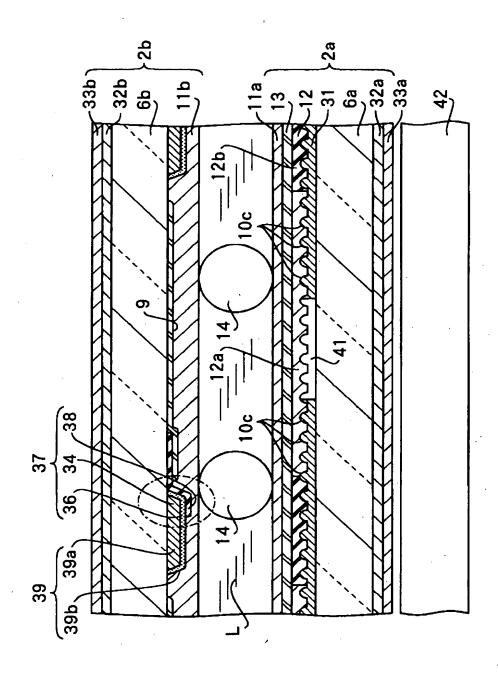
【図7】



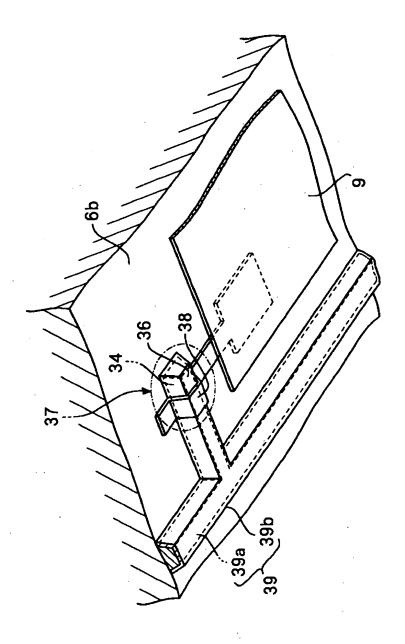
【図8】



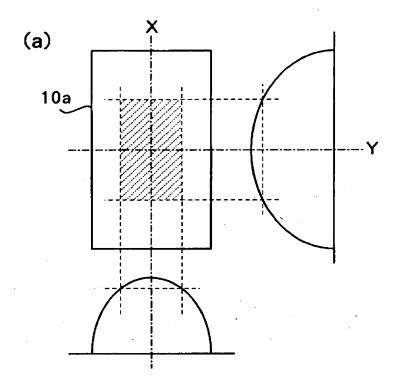
【図9】

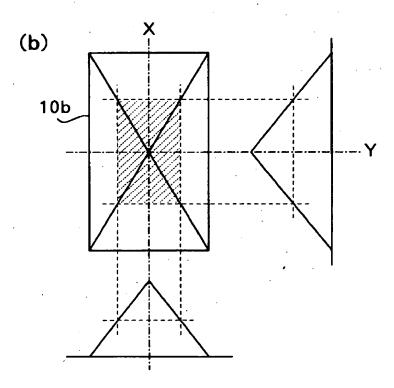


【図10】

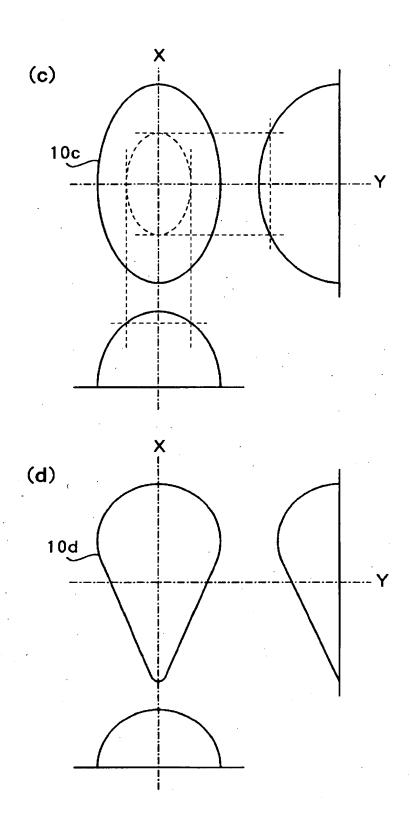


【図11】

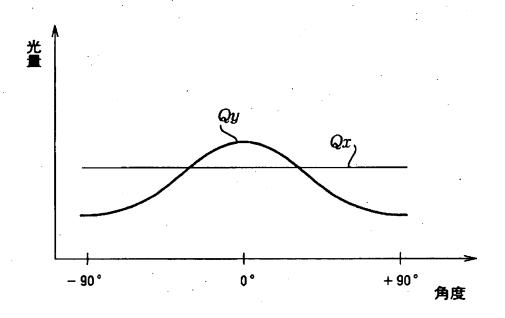




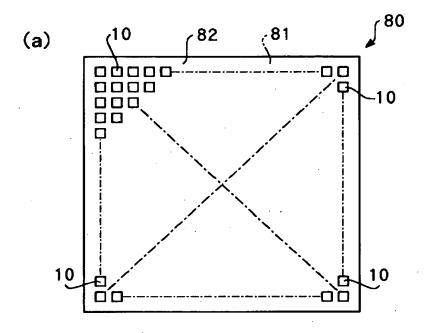
【図12】

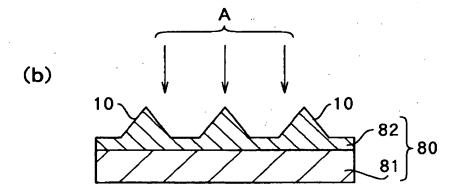


【図13】

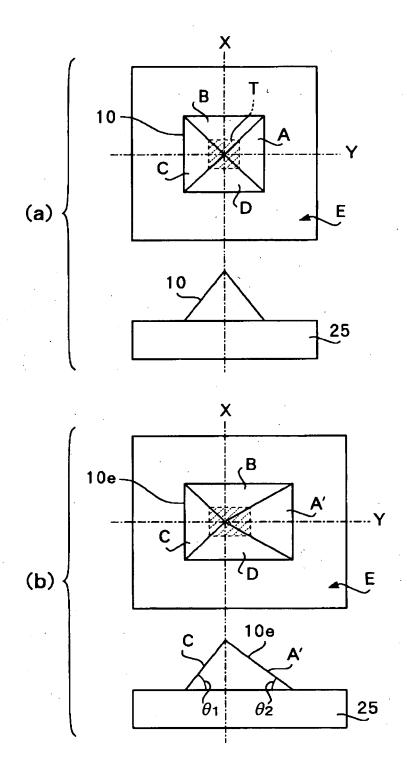


【図14】

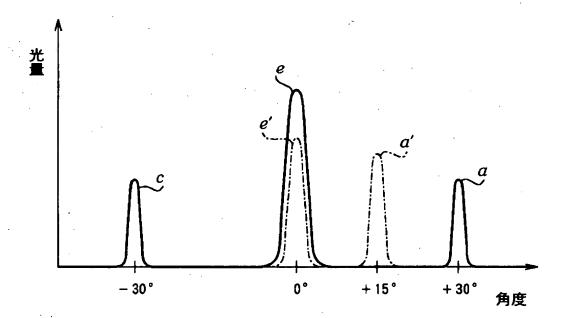




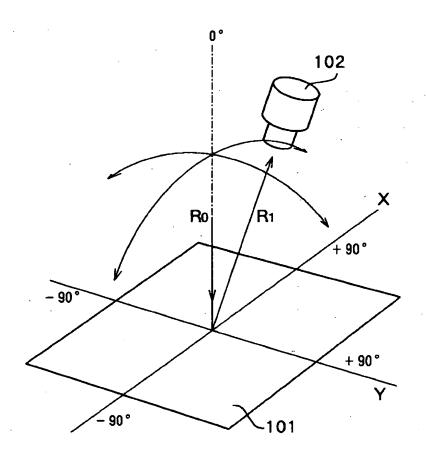
【図15】



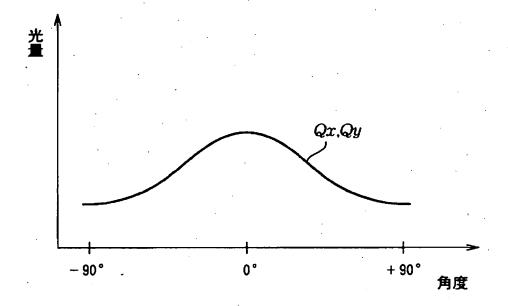
【図16】



【図17】



【図18】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 反射光が不要な視野角方向へ進行することを防止して、希望する視野 角方向へ向かう反射光の光量を増大させることにより、希望の方向から見たとき の表示の明るさを増大させることのできる液晶装置用基板を提供する。

【解決手段】 液晶を挟持する一対の基板のうち観察側と反対側に位置する液晶 装置用基板2aである。基材6aの表面に光反射膜としての画素電極9が形成される。光反射膜9の表面には複数の山部10cを並べて成るパターンが形成され、これらの山部10cは、自らを通る直交2軸線X,Yの一方の軸線に沿った立体形状と、他方の軸線に沿った立体形状とが互いに異なるように、長円形状のドーム形状に形成される。

【選択図】

図 2

出願人履歴情報

識別番号

[000002369]

1. 変更年月日 1990年 8月20日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

氏 名 セイコーエプソン株式会社